

研究スタッフ

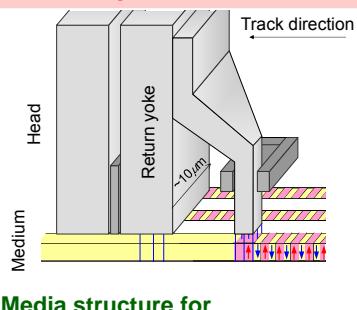
教 授： 齊藤 伸、 深教授： 角田 国清
助 教： 小川 智之、 日向 慎太朗
技術職員： 小野寺 政信、 特任教授： 飛世 正博

研究目的

本研究室では、スパッタ法を中心としたドライプロセスならびに化学合成を中心としたウェットプロセスを駆使することによって、超高密度磁気記録媒体、高性能・高感度を有するMRAM・SVヘッドおよび高周波デバイスを実現し得る、新たな材料設計・プロセス技術の確立を目指している。

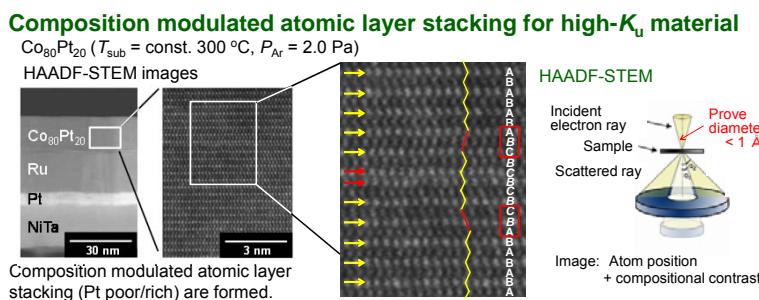
主な研究テーマ

HDD beyond 1 Tb/inch²



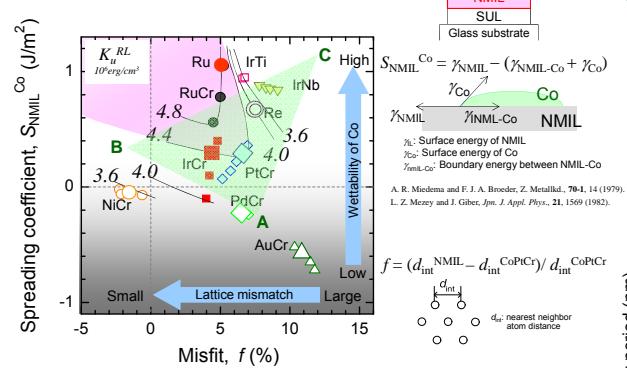
Media structure for perpendicular recording

In-line UHV sputtering machine

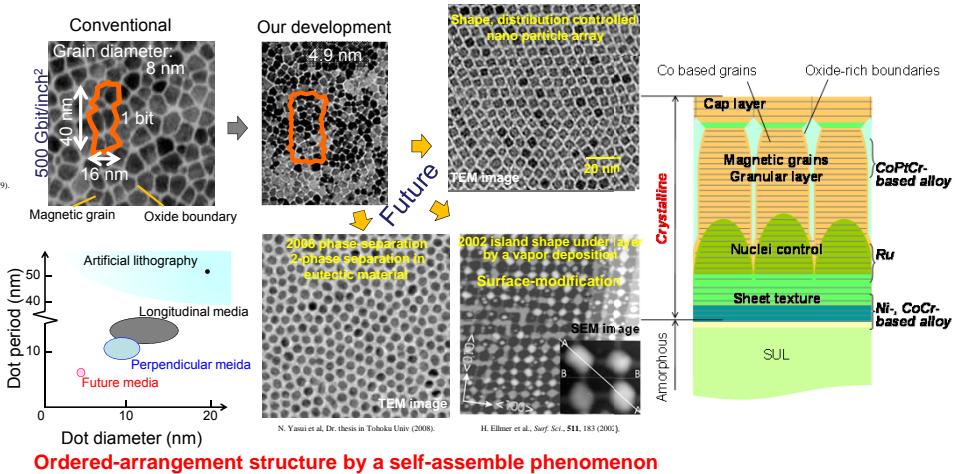


Fcc stacking as faults in macroscopic of hcp phase accompanies with irregularities for the periodicity of the compositional modulation

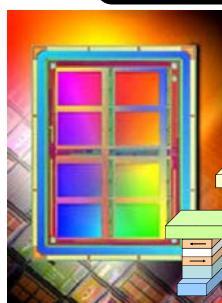
Alternative material to Ru



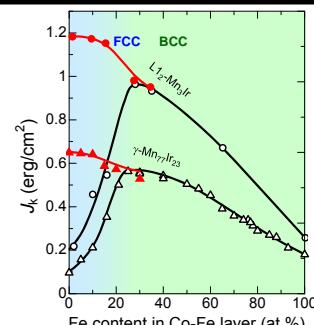
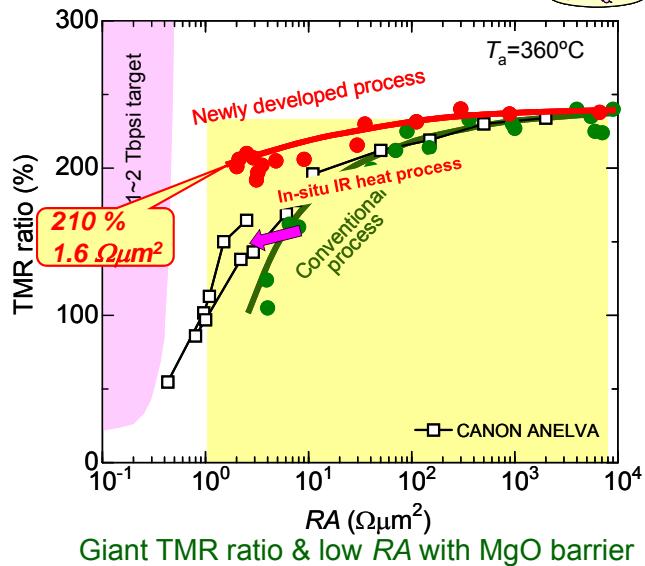
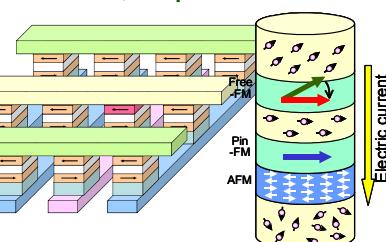
Microstructure control



Spin nano technology for high performance magnetoresistive random access memory

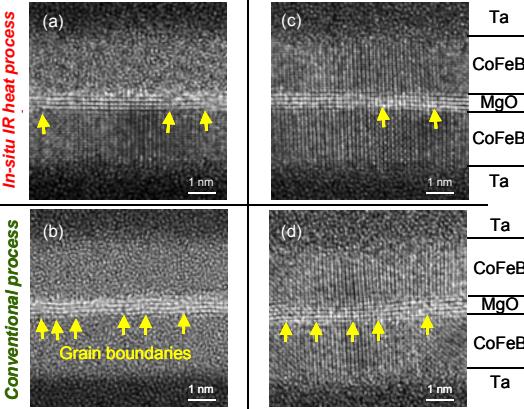


MRAM → Spin-RAM



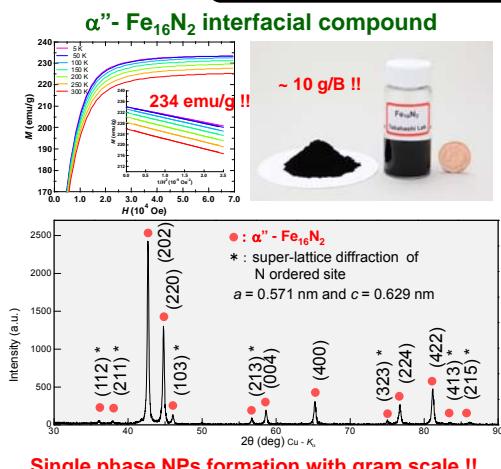
Enhanced exchange bias property with ultra-thin insertion layer

As-deposited. 360°C Post annealed

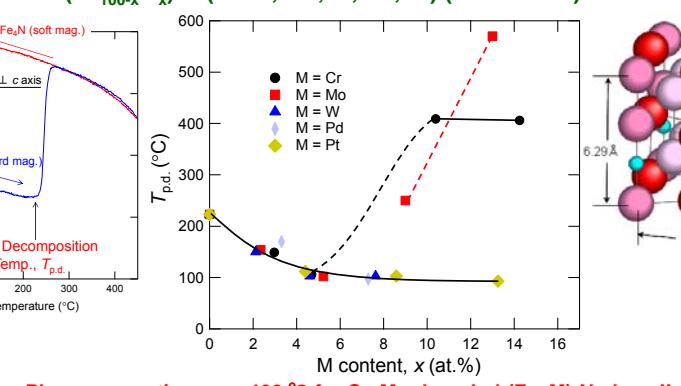


Promoting lateral grain size of the MgO barrier by the in-situ IR heat treatment

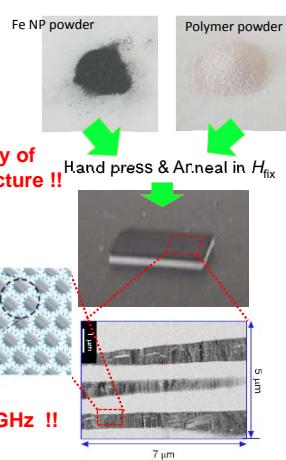
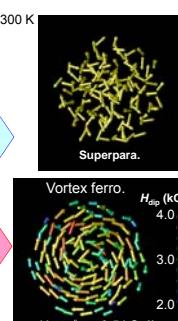
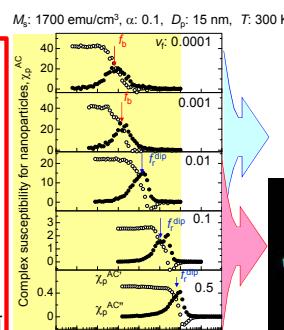
Fe-based magnetic nanoparticles for new magnetic devices



α'-(Fe_{100-x}M_x)-N (M=Cr, Mo, W, Pd, Pt) (N = 11 at.%) thin film



Challenge to GHz-band magnetic response



産学連携を希望するテーマ例

- ・薄膜材料の高品位、高付加価値、
- ・高機能化、および、新機能創出
- ・磁性ナノ材料を用いた新機能の探索
- ・磁性材料の評価技術に関する技術指導